

불순물에 의한 CdTe 單結晶의 전기적 특성

논문

Electrical Properties of Single Crystal CdTe by Impurity.

20~2~1

박 창 엽*

(Chang Yub Park)

[ABSTRACT]

N type single crystal CdTe is grown by doping Gallium as 0.01 percent, by using zone melting method. And also p type CdTe is grown by doping Ag, Sb, and Te as 0.01%. Resistivity and Concentration of the n.p type single crystal are measured. And then Li ions are implanted on the n type CdTe by high voltage accellerator with different amount of impurity. Indium is evaporated on the p type in high vacuum condition. These sample are heated so as to make P-N Junction in Argon gas flow. Electrical properties for solar cell are investigated. Photovoltage and current are found to be varied according to following factor: 1) amount of impurity 2) diffusion thickness 3) temperature and time for making P-N junction. Efficiency of the P-N Junction evaporated Indium is 6.5% when it is heated at 380°C for 15 minutie.

1. 서 론

CdTe 單結晶은 II-V 族 화합물중 結晶의 용이한 것으로 閃亞鉛礦의 結晶構造를 갖는다. B. Segall⁽¹⁾의 2人은 불순물을 도핑 하여 n型單結晶을 성장시켜 室溫에서 Hall 移動度가 $800\text{cm}^2/\text{volt. sec}$ 임을 밝혔다. R. Freichs⁽²⁾는 CdTe 單結晶을 氣相法으로 성장시켜 전기적성질을 조사하였고 R.T. Lynch⁽³⁾은 氣相反應으로 單結晶을 성장시켜 單結晶條件 및 結晶構造를 조사하였다. CdTe 單結晶은 溶融法이나 氣相反應法으로 성장시킬 수 있는 것으로 禁止帶幅에서 불때 이상적인 재료이긴 하나 고유저항이 높다는 것이 결점이다. P형의 불순물로서는 I 族 및 V 族이고 N형의 불순물로서는 III 族 및 VI 族元素이다. 본실험에서는 帶溶融法으로 가리움을 도핑하여 N型단결정을 만들고 Te, Ag 및 Sb를 도핑하여 P型單結晶을 만든 다음 이들의 비저항 不純物濃度를 조사한다. N型박판 및 P型박판을 만들어 N型박판은 이온加速注入裝置로 L_i^+ 이온을注入(Implantation)시켜 불순물의濃度에 따라 P-N 接合을 만들고 P型박판에는 인디움을 真空蒸著시켜 热處理

時 硝산두께를 다르게 P-N 接合을 시킨다. 이 P-N 接合은 太陽電池로 사용할 수 있으므로 太陽光을 照射할 때의 전기적특성을 조사한다.

2. 太陽電池의 이론

태양에너지가 태양전지에 전부 유효하게 이용된다고는 볼수없다. 어떤 波長보다 짧은 光만이 태양전지에 이용된다. 電子正孔對를 발생시키는데 필요한 禁止帶幅 Eg 보다 큰 餘分의 에너지는 열에너지로 손실이된다. 따라서 Eg 가 적으면 光에 의한 전류는 크나 열에너지로 손실이 많어진다. 태양전지는 일종의 다이오드로서 光을 받지 않을 경우에는 P-N 接合部에는 热力學的平衡狀態로 内部電場이 형성된다. 또한 N型領域이 P型領域에 대하여 正電位가된다. 이 상태에서擴散層에서 热的으로 만들어진 傳導電子 및 母體部(N型)에서 热的으로 만들어진 正孔은 각각 N型領域 및 P型領域으로 흘러 N型領域에서 P型領域으로 전류 I_o 가 흐른다. 母體部(N型)에 있는 많은 電子擴散層에 있는 많은 正孔中 eV_b 보다 큰 에너지를 갖는 것에 의하여 P型側에서 N型側으로 $-I_o$ 가 흘러 결국 全電流는 零이된다. P형측에 光을 照射하면 어떤 波長보다 짧은 波長의 光은 CdTe 結晶中에서 光의 에너지가 禁

* 정회원 : 연세대학교 이공대학 전기공학과 부교수

止帶幅보다 크면 結晶格子에 吸收되어 電子—正孔의 對를 이룬다. 이 電子—正孔은 $P-N$ 接合部에 擴散되어 이에 존재하는 内部電場에 의하여 電子는 N 型領域으로 正孔은 P 型領域으로 분리되어 N 型側이 負로 帶電하고 P 型側이 正으로 帶電된다. 따라서 외부회로를 연결하면 N 側에서 P 型側으로 光電流 I_L 가 흐르고 외부회로가 개방되어 있을 때 전류는 零으로 정상상태가 된다. N 側領域의 레미準位가 eV_{oc} 만큼 상승시 開放端의 전압 V_{oc} 가 단자에 걸린다. 즉 개방전압 V_{oc} 는

식(1)에서 I_o 가 적으면 V_{oc} 는 커진다. I_o 는 일반적으로 禁止帶幅 E_g 에 따라

$$I_o = Ce^{-\frac{E_s}{BkT}} \dots \dots \dots (2)$$

인 관계가 성립한다. I_o 가 적으면 V_{oc} 가 커지므로 I_o 를 적게 하기 위해서는 接合部에 불필요한 결합 또는 불순물이 존재 않는 이상적인 $P-N$ 接合을 만들고 母體部의 小數케리어의 擴散定數를 적게 수명을 길게 하여 不純物濃度를 증가함이 필요하다. (4) 식(2)에서 禁止帶幅이 넓으면 I_o 는 적고 따라서 開放電壓 V_{oc} 가 커진다. 電子-正孔中 $P-N$ 接合部에 모여 분리되는 비율 즉吸收된 光量子數에 대한 光電流의 比 즉 收集率은吸收係數少數케리어의壽命, 擴散定數, 表面再結合速度等에 의한다 (5) 收集率을 높여 효율을 향상시키기 위해서는 擴散層을 될수록 얕게 할이 좋다. (5) 고로 본실험에서는 擴散層을 얕게 하기 위하여 즉 I_o 를 적게 하여 V_{oc} 를 높이기 위하여 N型 박판에는 이온注入 加速器로 不純物濃度를 조정하면서 L_i^+ 이온을 주입시켜 $P-N$ 接合을 만들고 P型 박판에는 真空蒸着器로 I_n 을蒸着시켜서 $P-N$ 接合을 만든다.

3. 실험 및 결과

순도가 99.9999%인 Cd와 Te를秤量하기전에 표면의 산화물을 제거한다. Cd 및 Te를 질산으로 에칭한후 중유수로 씻어내어 전조시킨다. Te는 질산에 쉽게 용해하므로 중유법으로 산화물을 제거했다. 이 Cd 및 Te를 몰비로 정확히秤量하여 N型 CdTe를 만들기 위하여 가리움을 0.01% 혼합한다. P型 CdTe를 만들기 위해서 Sb, Ag, 및 Te를 0.01% 도핑한다. 이秤量된 재료를 외경 1cm인石英管에 넣고 5×10^{-5} Torr의 진공에서 봉한다. CdTe의融點은 1090°C이고 Cd와 Te는 800°C 부근의 온도에서反應하여 CdTe가 만들어지나 이온도에서 CdTe는 고체이므로融點以上의 온도까지 상승시키지 않으면完全反應치 않는다. 고로自動溫度調整器로 조정되는나선형シリコニ드, 電氣爐에試料管을 그림 1과같이白金線으로매달고爐

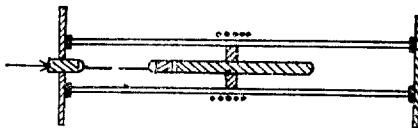
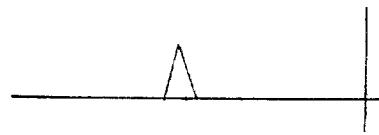


그림 1. 單結晶用 電氣爐

Fig 1. Electric furnace for single crystal

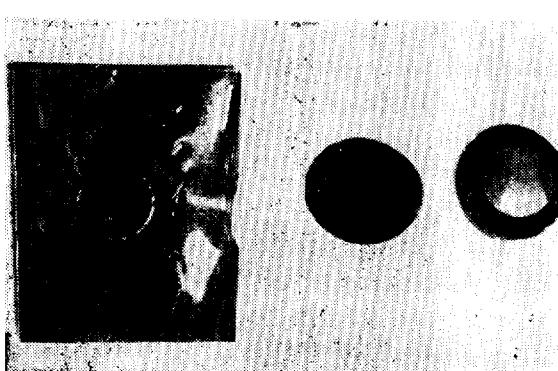
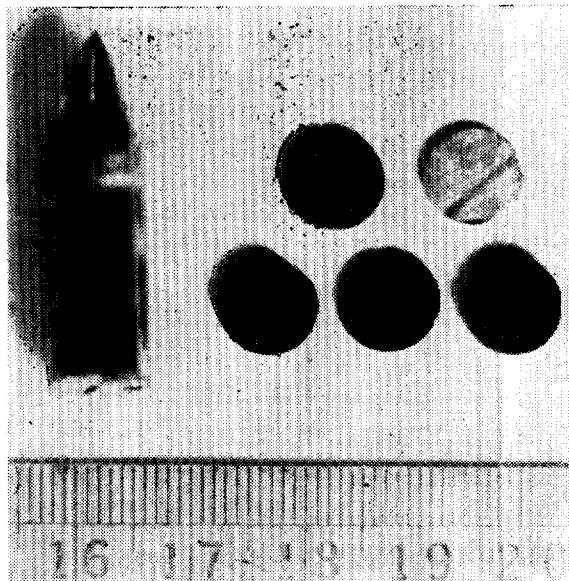


그림 2. 試料片의 오믹 접속특성

Fig. 2. Ohmic contact of the specimen.

의 온도를 300°C 로 올려 6時間 600°C 에서 24時間 두어 氣相反應 시킨 후 800°C 에서 6시간둔다.

다음 $1150^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 에서 6시간 두어 完全化合되게 한다. 電氣爐의 溫度를 처음부터 1150°C 로 急히 上昇시키면 Cd의 蒸氣壓이 높아져 폭발하게되고 Cd를 과잉 시켜도 폭발하기 쉬우므로 서서히 溫度를 上昇시킨다. CdTe가 完全化合되면 8mm/hr의 速度로 서서히내려 石英試料管을 밀바닥에서 부터 均一하게 冷却시켜 固體가 되면 다시 끌어 올려 이 과정을 여러번 반복하여

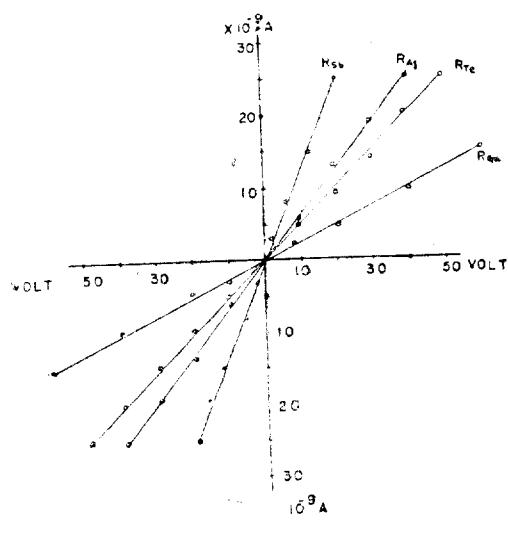


그림 3. 단결정과 박판

Fig. 3. Single crystal and wafer.

길이 3cm인 單結晶을 만든다.

이 結晶體를 成長方向으로 切斷하여 1000번 paper로 연마하고 回轉연마기로 2000번의 카보란덤(Carbordundum)으로 연마하여 CdTe의 표면을 거울면과 같이 만든다. 이를 超音波 세척기로 세척하여 진공진조시켜 두께 0.7mm, 직경 8mm인 박판과 표 1과 같은 규격의 試料片을 만든다. 이 試料片의 兩端에 인디움으

표 1

試料片	길이(cm)	두께(cm)	폭(cm)
N型 Ga 첨가	0.6	0.07	0.3
P型 Te 첨가	0.76	0.1	0.3
P型 Ag 첨가	0.7	0.08	0.3
P型 Sb 첨가	0.7	0.1	0.3

로 그림 3과 같은 특성을 갖는 端子를 오믹접속하여 不純物濃度 및 比抵抗을 측정한 결과는 표 2와 같고 저항은 그림 4와 같다.

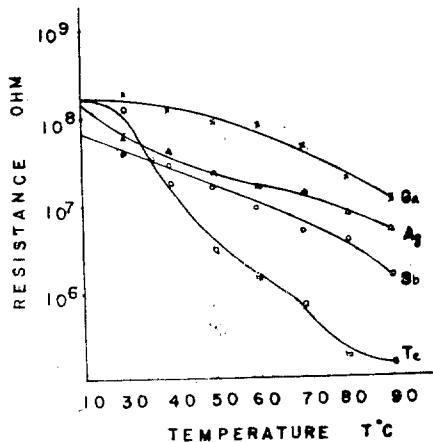


Fig. 4. Resistance of the crystal depending upon Temperature

표 2

試料片	不純物	比抵抗 Ωcm	不純物濃度 ion/cm^3
N型	Ga	7.0×10^7	3.7×10^{15}
P型	Te	8.0×10^7	2.1×10^{15}
P型	Sb	3.4×10^7	1.1×10^{16}
P型	Ag	5.5×10^7	4.1×10^{15}

위에서 만든 박판을 메타놀(methanol)로 표면의 불순물을 제거하여 증유수로 씻어낸 후 진조시켜 P-N 接合을 이루기 위하여 n形 박판에 Li^{+} 이온을 주입시킨다. 박판의 축면과 이면에 이온이 주입되지 않도록 알루미늄판으로 마스크를 씨워 이온 注入裝置(그림 5)의 타겟드룸(Target Chamber)에 설치한 小形電動機의 軸에 고정시켜둔다. Li 이온을 발생케하는 소스(source)는 Li_2CO_3 와 Al_2O_3 및 2SiO_2 를 혼합하여 1600°C 로 가열한후 急冷시켜서 $\text{Li}_2\text{OAl}_2\text{O}_3\text{SiO}_2$ 를 만든다. 이 재료를 펠라멘트(Tungsten Wire)에 Thiene과 섞어서 발리둔 다음 이온 注入裝置를 5×10^{-5} Torr로 계속 배기시키면서 펠라멘트를 1100°C 로 가열하면서 5KV의 이온 방출 전압을 걸면 Li 이온이 펠라멘트의 소스로 부터 방출된다. 이때 加速電壓 10KV~20KV의 전압을 공급하면 Li 이온이 加速되고 아인젤렌즈(Einzel Lenz)에 전압을 가하면 Li 이온빔이 파라테이 컵에 집중되어 적당한 양의 이온량(전류)이 파라테이 컵에 도

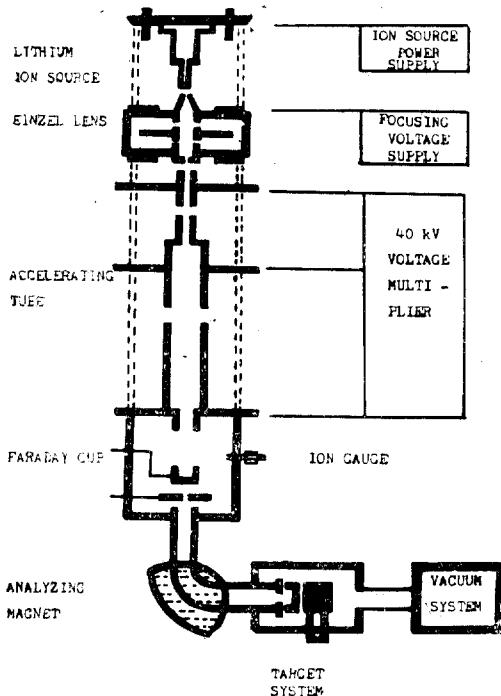


그림 5. 이온주입장치
Fig 5. Ion implantation system

달할때 이를 측정한 후에 파라데이컵을 옆으로 밀어낸 후 이온이 質量分析器로 들어가게 된다. 질량분석기로 들어간 Li 이온은 Li^6 및 Li^7 과 그외 다른 불순물들이 들어가서 질량분석기에서 Li^7 만이 분석되어 타겟드레버(Target Chamber)에 높인 n 形박판에 주입된다. 이온이 주입되는 면을 균일하게 하기 위하여 진공기내에 소형직류전동기를 설치하여 이 N 形박판을 회전시킨다. Li^7 이온단을 분석하는 방법은 다음과 같이 한다. 이온 소스에서 발생한 이온은 인가전압 V로서 가속된다. 따라서 이온이 하는 일은 eV 이고 운동에너

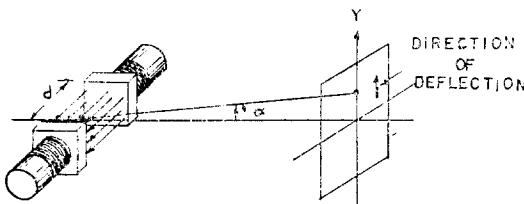


Fig 6. Magnetic deflection system

지 T 와 같어야만 한다.

여기서 m : 질량 gr

e ：電荷 esu

v : 이온의 속도 cm/sec

그림 6에서와 같이 이온빔의 운동방향과 수직인 磁界의 방향과 移動方向間에 正角으로 각 이온은 힘을 받는다. 따라서 이온빔이 굴절하게 된다. 이온이 갖는 힘 F_H 는

이다.

여기서 H : 磁界

C：光速

磁界에 의한 힘은 이온의 원심력 F_C 와 같아야 하므로

식 8을 식 3에 대입하면

當數를 제거하면 식 10 은

$$\frac{m}{\zeta} = H^2 r^2 / 20, 740 V \dots \dots \dots (11)$$

가 되다-

여기서 m : 원자의 단위질량

Z : 전자의 전화수

H : 자속밀도 gauss

r : 곡율반경 cm

V: 전압

굴절각은 90° 가 되게 제작되어 있으므로 $\frac{m}{e}$ 의 이온을 집중시키기 위해서 H 및 V 를 변화시켜야 한다. 식 11에서 H 를 증가 시키면 비중이 큰 이온이 타-겟드에 도달하고 V 를 증가시키면 비중이 가벼운 이온이 타-겟드에 도달한다. 磁氣質量分析器는 그림 7과 같은 것으로 이온 소-스(ion source)에서 나오는 이온은 磁界로 들어가 질량이 다른 이온은 磁界에서 曲卒半徑이 다른 통로를 지나가므로 같은 방향을 갖는 동일한 이온만이 V 및 H 의 값에 따라 분석될수 있다. 고로 굴절각이 90° 이고 曲卒半徑 5 cm 加速電壓이 10 KV가 가해질때 H 는 7360 gauss 가 되면 L_i^7 단이 분석된다. 분석된 L_i^7 이온은 진공타-겟드에 있는 박판에 주입된다. P 層을 이루기 위한 P 型不純物의 주입량 N_p 는

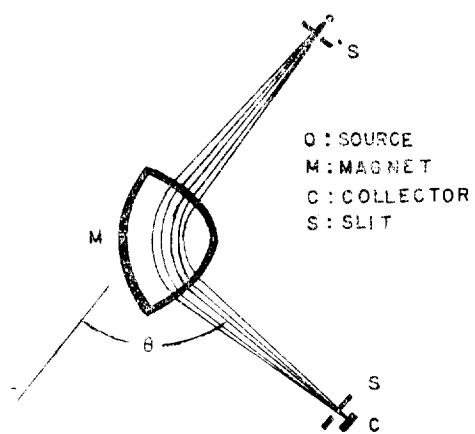


Fig 7. Focusing of a divergent ion beam by a wedge shaped magnetic field.

가 되어야 한다.

여기서 i : 이온전류 $\mu A/cm^2$

t : 이온의 주입시간 sec

고로 N 型單結晶의 不純物濃度 N_a 는 측정치에서 3.7 $\times 10^{15}$ ion/cm³ 이므로 i 가 $2\mu A$ 때 5分이면 $N_a = N_d$ 가 되므로 $N_a \geq N_d$ 가 되도록 하기 위해서 이온주입시간을 6.8.10.12. 分으로 했다. N 型인 母體에 L_i 이온을 주입시킨 후 알론 케스중에서 350°C로 25분간 가열하면 $P-N$ 接合이 이루워진다. 이 $P-N$ 接合의 N 型側에는 超音波溶接器(100w24KC)로 인더움을 사용하여 端子를 만들고 P 型側에는 실버페스트(Silver paste)로 접속한다.

*P*型 CdTe의 *P-N* 접합은 다음과 같이 만든다. *P*型 박판에 Al 마스크를 만들어 이를 蒸着器에서 1000A /min의 蒸着速度로 In을 蒸着시킨후 마스크를 벗겨 알론 캐스내에서 가열하여 표3과 같은 *P-N* 접합을 얻었다.

五 3

試料番號	확산 총 두께 μ	熱處理 温度 $^{\circ}\text{C}$	熱處理 時間 (min)	開放電壓 mV	短終電流 μA	不純物
1	1.8	550	10	250	3	Te
4	1.4	450	10	400	3.3	Te
6	0.9	380	10	600	18	Te
6'	1.0	380	15	580	17	Te
9	1.1	380	20	580	32	Te
10	0.9	380	10	500	5.	Sb

11	1.2	380	20	250	2	Sb
12	1.4	450	10	262	1	Sb
13	0.9	380	10	504	5	Ag
14	1.0	380	15	400	3	Ag

이온 주입으로 만든 $P-N$ 接合과 蒸着에 의한 $P-N$ 接合 다이오드의 특성을 조사한 결과는 그림 8과 같다. 光度에 의한 無負荷特性은 그림 9와 같다. 또한 출력 특성은 V-I 곡선으로 표시 할 수 있는 것으로 $P-N$ 接合

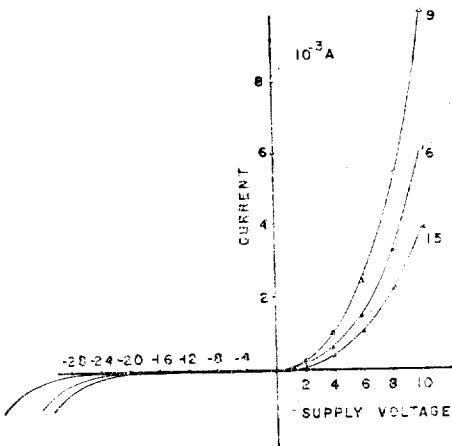


그림 8. 다이오드의 특성

Fig 8. Characteristics of P-N Junction

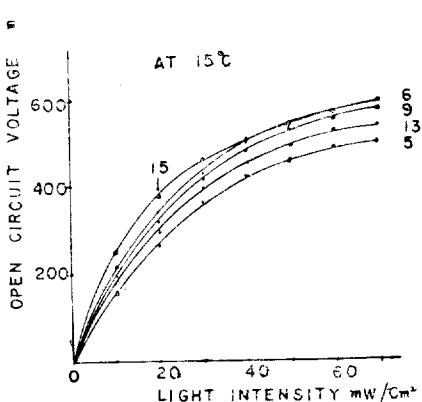


그림 9. 무부하 특성

Fig 9. No-load voltage according to light intensity.

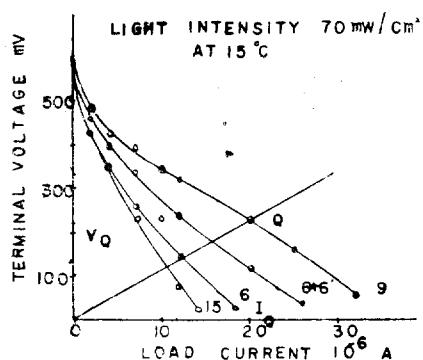


그림 10. V-I 특성곡선
Fig. 10. V-I Curve according to R_L at constant light intensity.

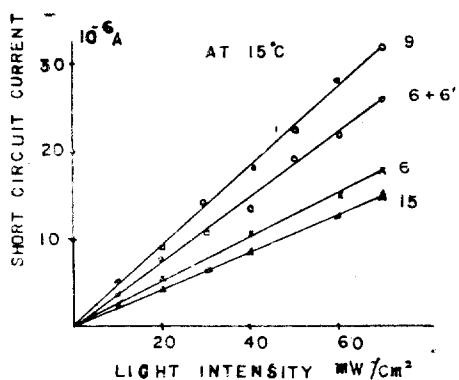


그림 11. 단락전류
Fig 11. Short circuit current according to light intensity

에 光을 照射하면 負荷變化에 의한 特성은 그림 10과 같다. 부하에 흐르는 전류는

인 전류가 흐른다. 일정한 光度下에서 短絡電流는 그림11과 같다. 출력은 V - I 곡선에 内接하는 矩形의 면적으로 결정되므로 큰 출력을 얻기 위해서는 短絡電流 및 開放電壓이 클것과 V - I 곡선의 形狀이 角을 이룰 필요가 있다. 주어진 負荷 R_L 에 대한 負荷直線은 oQ 이고 負荷에 공급하는 전력은 $I_Q V_Q$ 이며 이 전력을 최대로

하는 조건은 식 1, 식 13에서 $\left(\frac{dP}{dI}\right) = 0$ 으로서 최대 출력 을

가 되다.

負荷 R_L 에 의한 출력특성은 그림 10에서 P 型 $CdTe$ 인 경우 I_Q 는 $19.8\mu A$ 이고 V_Q 는 $230mV$ 로 최대출력은 $4.55mW$ 이며 효율은 6.5% 이다. N 형인 경우는 그림 9 및 10에서 $N_{o,15}$ 로 I_Q 는 $10\mu A$ 이고 V_Q 는 $120mV$ 로 효율은 1.7% 이다.

CONCLUSION

Efficiency of the CdTe solar cell of which Li ions are implanted, is 1.7 percent and photovoltage of the cell is larger than other sample when implanted impurity is 7.5×10^{15} ion/cm³. which means that Li ion is implanted for 10 minutes at $2\mu\text{A}$. The efficiency of the CdTe solar cell of which Indium is vacuum evaporated, is 6. 5%. And it is fount that heating time (15 minutes) is optimum at 380°C for n/p Junction. The photovoltage and short current vary with diffusion thickness. With white light, it is increased with diffusion thickness up to 1μ and begin to decrease slowly with increasing it.

참고문헌

1. B. Segall, M.R. Lorenz, R.E. Halsted, phys Rev. 129, 249 1963.
 2. R. Frerichs, phys. Rev 72. 594. 1947.
 3. R.T. Lynch, J. Appl phys 33. 1009. 1961.
 4. M.B. Prince, Silicon Solar Energy Converters. J. Appl. phys. 26. 534. 1955.
 5. M. Wolf, Limitation and possibilities for Improvement of Photovoltaic Solar Energy Converters Proc IRE 48 [7] 1960.
 6. R. W. Kiser, "Introduction to Mass Spectrometry and Its Applications", 1965, 44p~51p